

南臺科技大學 106 學年度第 2 學期課程資訊

課程代碼	10D30601
課程中文名稱	微機電製程技術簡介
課程英文名稱	Micro Electro Mechanical System Process Technology
學分數	3.0
必選修	選修
開課班級	四技自控三甲 四技自控三乙四技奈米三甲四技奈米三乙四技車輛三甲四技車輛三乙
任課教師	陳韋志
上課教室(時間)	週一第 4 節(K510) 週一第 5 節(K510) 週一第 6 節(K510)
課程時數	3
實習時數	0
授課語言 1	華語
授課語言 2	
輔導考照 1	無
輔導考照 2	無
課程概述	讓學生對於微機電技術有總體的概念，其市場應用與理論基礎的範圍，之後再細部解說微奈米加工製程的介紹。
先修科目或預備能力	無
課程學習目標與核心能力之對應	<p>※編號，中文課程學習目標，英文課程學習目標，對應系指標</p> <p>-----</p> <p>1.能具備微機電系統基本知識，To be able to have a basic knowledge of Micro Electro-Mechanical Systems，1 工程知識</p> <p>2.能了解微機電系統實務所需的技術，The technology required to understand Micro Electro-Mechanical Systems Practice，2 設計實驗</p> <p>3.能了解運用微機電系統的機會，Understand the use of Micro Electro-Mechanical Systems occasions，4 設計整合</p> <p>4.能了解微機電系統造成的影響，Understand the Micro Electro-Mechanical Systems impact，1 工程知識</p>
中文課程大綱	<p>1.微機電介紹</p> <p>2.微機電之應用與市場</p> <p>3.無塵室介紹</p> <p>4.半導體之微機電製造</p> <p>5.微影技術</p> <p>6.薄膜沉積</p>

	7.濕蝕刻技術 8.乾蝕刻技術 9.特殊加工製程技術
英/日文課程大綱	1. Introduction of MEMS 2. Introduction to MEMS Applications and Marketing 3. Introduction of Cleanroom 4. MEMS-Fabrication for Semiconductor 5. Lithography 6. Thin Film Deposition 7. Wet Etching Technology 8. Dry Etching Technology 9. LIGA Process
課程進度表	
教學方式與評量方法	※課程學習目標，教學方式，評量方式 ----- 能具備微機電系統基本知識，--，-- 能了解微機電系統實務所需的技術，--，-- 能了解運用微機電系統の場合，--，-- 能了解微機電系統造成的影響，--，--
指定用書	
參考書籍	
教學軟體	
課程規範	